

課題番号 : F-13-TU-0074
利用形態 : 機器利用
利用課題名 (日本語) : 光学デバイス製作の為のメンブレン構造試作
Program Title (English) : Trial manufacture of a membrane for optical devices
利用者名 (日本語) : 田中 裕之
Username (English) : H.Tanaka
所属名 (日本語) : 株式会社 EUVL 基盤開発センター
Affiliation (English) : EUVL Infrastructure Development Center, Inc.

1. 概要 (Summary)

光学デバイスに応用するため、中空の微細ハニカム構造を製作し、かつ、表面に成膜を施す。

2. 実験 (Experimental)

以下の装置を主に用いて、中空の微細ハニカム構造を製作した。

エッチングチャンバー、両面アライナ、スピコート、スプレー現像装置、ステッパ、酸化炉 (MEMS 用)、B 拡散炉、B 押し込み炉、Deep RIE 装置#1、Deep RIE 装置#2、アネルバ RIE 装置、熱電子 SEM、エリプソ、クイックコート

3. 結果と考察 (Results and Discussion)

6 インチウェハでの試作結果として、面内歩留まり 100%のものが出来た。今後の課題は、歩留まりを保ったまま、更に構造の微細化による性能向上を目指す。

4. その他・特記事項 (Others)

なし

5. 論文・学会発表 (Publication/Presentation)

なし

6. 関連特許 (Patent)

なし